

平成 24 年 2 月 23 日

各 位

東京工業大学技術部
技術部長 伊東 利哉

東京工業大学技術部 平成 23 年度技術発表会のお知らせ

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

この度、標記技術発表会を下記のとおり開催しますのでご案内申し上げます。本技術発表会は、様々な分野にわたる教育・研究支援活動の成果などを発表し、意見交換することにより教育・研究に関わる技術職員の技術的交流と資質の向上を図ることを目的としております。

多くの方にご参加いただき活発な意見交換の場にしたいと考えておりますので、ご多用中とは存じますが、懇親会と併せて多数の方にご参加いただければ幸いに存じます。

なお、開催案内、ポスター、発表会プログラムは東京工業大学技術部ホームページ (<http://www.tsd.titech.ac.jp/>) に掲載しております。

記

日 時：平成24年 3月13日（火）10時より（受付開始 9:30）

会 場：東京工業大学すずかけ台キャンパス すずかけホール 3階 多目的ホール

懇 親 会：17時30分よりすずかけホール 3階ラウンジにて開催します。

当日受付にて会費 3,000 円を申し受けます。

案 内 図：http://www.titech.ac.jp/about/campus/s_googlemap.html

マップ中央付近の円形の建屋（H1棟）及び隣接する建屋（H2棟）が会場です。

参加申込：平成23年度技術発表会開催案内（下記URL）の「参加（聴講）申し込み」ページにてお申込み下さるようお願い申し上げます。（申込締切 3月 9日(金)）

URL http://www.tsd.titech.ac.jp/event/2011/tech_presentation/info2011.html

最寄り駅：東急田園都市線 すずかけ台駅下車 徒歩約 7 分

問い合わせ先：東京工業大学技術部 精密工作技術センター 石山 修

Tel.: 045-924-5320, E-mail: oishiyama@tsd.titech.ac.jp



平成23年度 東京工業大学技術部

技術発表会



特別講演 三島 良直 教授

(東京工業大学総合理工学研究科)

「低炭素社会へ向けた耐熱金属材料の挑戦」

日時：平成24年3月13日（火）

午前10時～（受付開始午前9時30分）

場所：東京工業大学すずかけ台キャンパス

講演会・口頭発表会場：すずかけホール多目的ホールH2棟3階

ポスター発表会場：すずかけホールラウンジH1棟3階

東京工業大学技術部 <http://www.tsd.titech.ac.jp>

平成 23 年度 技術発表会プログラム

開催日：2012 年 3 月 13 日（火）

場 所：東京工業大学 すずかけ台キャンパス

口頭発表・講演会場：すずかけホール 3 階多目的ホール

ポスター会場：すずかけホール 3 階ラウンジ

受付開始：9:30

○開会式 (10:00-10:10)

開会挨拶

技術部長

伊東 利哉

○特別講演 (10:10-11:10)

「低炭素社会へ向けた耐熱金属材料の挑戦」

東京工業大学 大学院総合理工学研究科

教授（理事・副学長） 三島 良直

=== 休憩 (11:10-11:20) ===

○口頭発表 (11:20-14:35) 発表25分、質問5分

1. 清 悦久（すずかけ台分析支援センター）（11:20-11:50）

「400MHzNMR における INADEQUATE 測定」

～2011 年度 機器・分析技術研究会口頭発表報告～

2. 原 智恵子（すずかけ台分析支援センター）（11:50-12:20）

「電子はかりを使用したマイクログラムオーダーでの試料はかり取り操作の実際」

=== 昼休み (12:20-13:20) ===

3. 奥野 和泉（設計工作技術センター）（13:20-13:50）

「旧型マシニングセンタ豊田工機 PV5 のメンテナンス及び活用について(仮)」

4. 岩田 正孝（設計工作技術センター）（13:50-14:35）

「伝熱学と複写定着機構の関係について」

第 4 報 熱ローラ式定着機の断熱化対策による高性能化」

○ポスター発表紹介(14:35-15:00)

各ポスター発表者によるショートトーク（1 人 2 分）

=== 休憩 (15:00-15:15) ===

○ポスター発表(15:15-16:45)

1. 山道 桂子、山本 洋子、鈴木 麻美絵 (バイオ技術センター)
「バイオ技術センターにおける電子顕微鏡依頼業務の紹介 ―シアノバクテリアの形態観察―」
2. 石川 薫代 (すずかけ台分析支援センター)
「マイクロ電子天びん技術研修会」実施に携わって」
～技術部研修 No.9 2011 年度信州大学 機器・分析技術研究会口頭発表報告～
3. 小泉 公人 (すずかけ台分析支援センター)
「NMR/MS ミニセミナーを開催して」
4. 佐藤 美那 (半導体・MEMS 支援センター)
「スパッタ装置を用いたSiO₂成膜中におけるプラズマ発光分光分析」
5. 松谷 晃宏 (半導体・MEMS 支援センター)
「熱ナノインプリントレジストマスクを用いたCl₂/Xe誘導結合型プラズマエッチングによる
SOI 基板上的サブ波長回折格子の製作」
6. 庄司 大 (半導体・MEMS 支援センター)
「バーニヤ目盛を用いてアライメント精度を向上させたマスクアライナ利用講習会用
フォトマスクの製作」
7. 西岡 國生 (半導体・MEMS 支援センター)
「微細放電加工機によるフォトマスクのクロム薄膜のパターニング」
8. 和田 選 (精密工作技術センター)
「精密工作技術センターの人材育成プログラムと製作紹介」
9. 脇田 雄一 (ナノ支援センター)
「第一種東京都公害防止管理者の資格講習受講報告」
10. 田村 茂雄 (ナノ支援センター)
「日本顕微鏡学会走査電子顕微鏡分科会主催講演会 SCAN TECH 2011 参加報告」
11. 一瀬 光 (情報基盤支援センター)
「MS チームの業務内容と現状について」

A～J. 研究支援センター目標ポスター

=== 休憩、ポスター撤去(16:45-17:00) ===

○閉会式 (17:00-17:15)

技術部研修 修了証書授与
定年者への記念品贈呈
閉会挨拶

研修・出張審査委員会主査 筒井 一生
技術企画室

○懇親会 (17:30-19:30) (会場:すずかけホール3階 ラウンジ)

要旨集ならびに発表会の情報は下記のURLをご覧ください。

URL http://www.tsd.titech.ac.jp/event/2011/tech_presentation/info2011.html

お問い合わせ先：東京工業大学 技術部

技術企画室（大岡山） Tel：03-5734-2381

技術企画室（すすかけ台） Tel：045-924-5333

Email：kikaku@tsd.titech.ac.jp